

чительно с оптической точки зрения. Такая трактовка часто излишне осложняет простые задачи, ранее решенные другим путем, и не оправдывается ходом развития электроники, когда даже в самые последние годы новые конструкции зарождаются независимо от электроннооптических представлений об их действиях.

В связи с этим следует отметить пренебрежение авторов технологическими вопросами, которые нередко являются наиболее сложными в действительном осуществлении новых приборов.

В самой большой мере теория авторов не успевает за жизнью в области ультравысокочастотных приборов, и главы, относящиеся к ним, не отражают в полной мере уровня современного развития техники и представляют интерес лишь как неплохая попытка систематизации.

*Редактор.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Введение. Электронные лучи . . . . .	11
<b>Часть первая</b>	
<b>ЭЛЕКТРОН В ПОЛЕ</b>	
<i>Глава первая. Движение электронов в статическом поле . . . . .</i>	16
A. Движение электрона . . . . .	17
1,1. Электрон . . . . .	17
1,2. Общие сведения об электрических и магнитных полях . . . . .	20
1,3. Общие законы движения и движение в однородном поле . . . . .	24
1,4. Движение в аксиально-симметричном поле . . . . .	27
1,5. Законы подобия . . . . .	29
1,6. Модели поля и движения . . . . .	32
1,7. Характер пути электронов в электрическом и магнитном полях . . . . .	34
B. Электронный пучок с оптической точки зрения . . . . .	37
1,8. Закон преломления в электронной оптике . . . . .	37
1,9. Природа фокусировки по направлению . . . . .	40
1,10. Теорема Гельмгольца . . . . .	42
1,11. Различные фокусировки . . . . .	44
B. Особенности электроннооптического хода лучей . . . . .	45
1,12. Принципиальные различия между оптическими и электроннооптическими средами . . . . .	45
1,13. Влияние объемного заряда на ход лучей . . . . .	47
1,14. Зависимость действия поля от направления пробега . . . . .	49
1,15. Ускорение и смещение . . . . .	50
1,16. Сужение хода лучей . . . . .	52
1,17. Собирающее действие замедляющего поля . . . . .	54
<i>Глава вторая. Движение электронов в высокочастотном поле</i>	
A. Вопросы движения . . . . .	56
2,1. Высокочастотные поля . . . . .	57
2,2. Траектории в высокочастотном поле . . . . .	58
2,3. Фокусировка по направлению . . . . .	59
2,4. Фокусировка по фазе . . . . .	61
2,5. Законы подобия . . . . .	63
B. Энергетические вопросы . . . . .	65
2,6. Энергетические соотношения . . . . .	65
2,7. Отдельный процесс и среднее изменение энергии . . . . .	67
B. Основы технических применений . . . . .	69

<b>Глава третья. Основы устройства электронных приборов . . . . .</b>	70
A. Электронная эмиссия . . . . .	70
3.1. Картина металла . . . . .	70
3.2. Возможность эмиссии электронов . . . . .	72
3.3. Термоэлектронная эмиссия . . . . .	75
3.4. Фотоэлектронная эмиссия . . . . .	79
3.5. Вторичная эмиссия . . . . .	81
B. Электронооптические принципы движения частиц в полях . . . . .	84
3.6. Фокусировка по направлению и образование изображений . . . . .	84
3.7. Разложение и анализ . . . . .	85
3.8. Дисперсия и фокусировка . . . . .	88
C. Выбор энергии частиц . . . . .	89
3.9. Энергетические соотношения в статическом поле . . . . .	89
3.10. Энергетические соотношения в высокочастотном поле . . . . .	91
D. Принципы управления . . . . .	92
3.11. Управление направлением . . . . .	93
3.12. Управление силой тока . . . . .	95
3.13. Формальное описание процессов управления . . . . .	98
E. Возвращение электронов в металл . . . . .	100
3.14. Проникновение зарядов в металл . . . . .	101
3.15. Превращение энергии при проникновении электронов в металл . . . . .	102
3.16. Отвод избыточного заряда и избыточной энергии . . . . .	105
F. Взаимодействие с внешним контуром тока . . . . .	108
3.17. Процесс взаимодействия . . . . .	108
3.18. Стекание заряда в квазистационарном случае . . . . .	110
3.19. Некоторые применения явлений взаимодействия . . . . .	113
3.20. Падающая характеристика и возбуждение колебаний . . . . .	115
3.21. Взаимодействие с высокочастотным колебательным контуром . . . . .	117
<b>Глава четвертая. Приемы управления электронным лучом . . . . .</b>	119
A. Выбор поля . . . . .	120
4.1. Электрическое или магнитное поле? . . . . .	120
4.2. Ограничение поля . . . . .	122
4.3. Симметрия поля и его зеркальное изображение . . . . .	125
4.4. Электрическая фокусировка без промежуточного потенциала (двухполюсная система) . . . . .	128
4.5. Газовая фокусировка . . . . .	131
B. Влияние скорости . . . . .	134
4.6. Искажения поля у поверхности катода . . . . .	134
4.7. Оформление поля вблизи катода . . . . .	135
4.8. Движение разноименно заряженных частиц . . . . .	136
4.9. Уменьшение скорости электронов для лучшего управления . . . . .	137
4.10. Тормозящие поля как фильтры . . . . .	138
C. Вопросы геометрии хода лучей . . . . .	140
4.11. Исследование спектра . . . . .	140
4.12. Увеличение для целей измерения . . . . .	142
4.13. Достижение максимального действия . . . . .	144
D. Многократное управление . . . . .	146
4.14. Применение нескольких элементов . . . . .	147
4.15. Многократное применение одного и того же элемента . . . . .	148
4.16. Круговое движение и ограничение числа ступеней . . . . .	149
4.17. Многоступенчатое получение изображений . . . . .	151

D. Обратное действие (реакция) и обратная связь . . . . .	152
4.18. Реакция и усиление при процессах управления . . . . .	152
4.19. Обратная связь и возбуждение колебаний . . . . .	154
<b>Глава пятая. Элементы устройства . . . . .</b>	156
A. Источники заряженных частиц . . . . .	157
5.1. Накаленный катод . . . . .	157
5.2. Фотоэлектрический и вторично эмиттирующий катоды . . . . .	158
5.3. Источники положительных ионов . . . . .	160
B. Управляющие элементы при статических полях . . . . .	161
5.4. Сферические электрические электронные линзы . . . . .	161
5.5. Сферические магнитные электронные линзы . . . . .	165
5.6. Цилиндрические линзы . . . . .	167
5.7. Диспергирующая призма и фокусирующая линза . . . . .	171
5.8. Электронное зеркало . . . . .	174
5.9. Диафрагма и выбор ее положения . . . . .	176
5.10. Окошко для выпуска электронов . . . . .	179
5.11. Вопросы фильтрации . . . . .	181
V. Управляющие элементы при переменных полях . . . . .	183
5.12. Симметричный отклоняющий элемент . . . . .	184
5.13. Затвор . . . . .	186
5.14. Направляющий цилиндр в качестве ирисовой диафрагмы . . . . .	189
5.15. Управляющая сетка . . . . .	193
5.16. Фазовая диафрагма и фазовая линза . . . . .	195
G. Обнаружение заряженных частиц . . . . .	197
5.17. Сообщение видимости корпускулярным лучам . . . . .	198
5.18. Флуоресцирующий экран . . . . .	200
5.19. Фотографирование флуоресцирующего экрана . . . . .	205
5.20. Непосредственная фотографическая съемка . . . . .	207
5.21. Последующее ускорение . . . . .	210

**Часть вторая****УСТРОЙСТВО ПРИБОРОВ**

<b>Введение. Терминология и систематика приборов . . . . .</b>	212
<b>Глава шестая. Приборы управления током . . . . .</b>	215
A. Простейшие приборы для превращения излучения в ток (фотоэлементы) . . . . .	216
6.1. Формы поля и характеристики вакуумного элемента . . . . .	216
6.2. Типы нормальных вакуумных фотоэлементов . . . . .	219
6.3. Ионизационная камера . . . . .	221
B. Приборы управления током с увеличением посредством вторичной эмиссии (умножители) . . . . .	223
6.4. Разновидности умножителей . . . . .	224
6.5. Умножители с сетками . . . . .	225
6.6. Умножители с пластинами и электронными линзами . . . . .	228
6.7. Умножители с пластинами и простыми фокусирующими полями . . . . .	229
6.8. Применения и мощность умножителя . . . . .	232
V. Другие приборы с увеличением . . . . .	234
6.9. Газонаполненные фотоэлементы . . . . .	234
6.10. Счетчик импульсов . . . . .	237
6.11. Пропорциональный счетчик . . . . .	238
6.12. Фотоэлемент со световой реакцией . . . . .	239